

研究速報: 免震精密生産施設のための圧電アクチ ュエータを用いた総合的アクティブ微振動制御シス テム: 第1報、スマート構造による内生微振動の制 御

その他のタイトル	Comprehensive Active Microvibration Control System Using Piezoelectric Actuators for Base-Isolated Precision Manufacturing Facilities : 1st Report, Control of Microvibration Generated in Building with Smart Structure		
著者	嶋崎 守,藤田 隆史,橋本 嘉之,吉岡 宏和,北原 隆,小川 智浩		
雑誌名	生産研究		
巻	56		
号	6		
ページ	514-517		
発行年	2004		
URL	http://hdl.handle.net/2261/00078710		

doi: info:doi/10.11188/seisankenkyu.56.514

19J	- 76 	<u></u>	÷κ	
石开	空	凍	報	

免震精密生産施設のための圧電アクチュエータを用いた 総合的アクティブ微振動制御システム

――第1報,スマート構造による内生微振動の制御――
 Comprehensive Active Microvibration Control System Using Piezoelectric Actuators for
 Base-Isolated Precision Manufacturing Facilities
 1 st Report, Control of Microvibration Generated in Building with Smart Structure —

嶋 崎 守^{*}・藤 田 隆 史^{*}・橋 本 嘉 之^{**}・ 吉 岡 宏 和^{**}・北 原 隆^{***}・小 川 智 浩^{****} Mamoru SHIMAZAKI, Takafumi FUJITA, Yoshiyuki HASHIMOTO,

Hirokazu YOSHIOKA, Takashi KITAHARA and Tomohiro OGAWA

1. まえがき

半導体製造の分野では、高集積化・高性能化によって、 生産施設の微振動が問題となっており、現在、除振テーブ ルを用いた局所的なアクティブ微振動制御が実用化されて いる¹⁾.しかし、局所的なアクティブ微振動制御では、今 後のさらなる半導体の高集積化・高性能化には対処しきれ なくなるため、藤田らは、生産施設の床や建物全体の微振 動をアクティブ制御して微振動低減の要求に答える研究を 行なってきた²⁾.また、日本のような地震国における精密 生産施設は、建物内部の設備機器をも効果的に地震から守 るために、免震構造の採用が望ましい.

そこで本研究では、免震精密生産施設を対象に、建物を 構造部材にアクチュエータを組込んだスマート構造とし、 さらに免震層にもアクチュエータを装備して、設備機器等 からの内生微振動に対するアクティブ制御と地盤の常時微 動や強風による外来微振動に対するアクティブ制御を同時 に行なう総合的アクティブ微振動制御システムを開発す る.

本報では,総質量 6.9tの免震半導体工場建物モデルを 設計・製作し,建物の柱・はりにピエゾアクチュエータを 組込んで内生微振動に対するアクティブ制御について検討 した結果を報告している.

2. 建物モデル

2.1 建物モデル概要

本研究で設計・製作された免震半導体工場を模した建物 モデルを図1に示す.このモデルは,長手方向5.0m,短 手方向3.0m,高さ4.0m,総質量6.9tの2層鉄骨造で,4

*東京大学生産技術研究	宅所 機械・生体系部門
**(株) 竹中工務店 技	術研究所
***日立プラント建設(材	朱) 松戸研究所

****日立プラント建設(株) 松戸研究所 ****住友重機械工業(株) 技術開発センター



生産研究

図1 建物モデル

基の多段積層ゴムにより免震支持されている.免震周期は 約0.7 Hzで,免震層中央にはエネルギ吸収のための粘性 せん断型ダンパが装備されている.

2.2 ピエゾアクチュエータを組込んだスマート構造

図2,3に示すように,建物モデルは,1階の各柱脚部 と2階の長手方向のはり中央部にピエゾアクチュエータが 合計20個組込まれたスマート構造を有している.これに よって柱およびはりの曲げモーメントを制御³⁾すること で内生微振動に対するアクティブ制御を行なうことができ る.なお,このピエゾアクチュエータの外形寸法は25× 25×36^Hmmで,最大変位は29.7 µm,また,最大発生力 は21.2 kNである⁴⁾.

2.3 モデリング

図4は有限要素法を用いて求められた建物モデルの振動 モードのうち、制御対象とした合計6つのモードを示した

56巻6号 (2004)





図2 柱に組込まれたピエゾアクチュエータ



図3 はりに組込まれたピエゾアクチュエータ



図4 制御対象のモード形状

ものである. 各モードは, 短手方向への柱の変形の4次モ ードと6次モード, 長手方向への柱の変形の5次モードと 10次モード, 2階フロアが鉛直方向に振動する8次モード と15次モードである. なお, 建物モデルの長手方向を*x* 方向, 短手方向をy方向, 鉛直方向をz方向とした. 建物 モデルを自由度6(*x*, *y*, *z*方向の各並進変位と各軸まわ りの回転角変位)の節点からなる有限要素モデルで表現し たときの運動方程式は以下のようになる.

ここで [*M*] は質量行列, [*K*] は剛性行列, |*X*| は各節点の並 進変位と回転角変位のベクトル, [*H_F*] は内生微振動外乱 が作用する節点を示す行列, |*F*| は内生微振動外乱のベク トル, [*H_u*] はピエゾアクチュエータが発生する曲げモー メントが作用する節点を示す行列である.また, *U* はピ エゾアクチュエータが発生する曲げモーメントのベクトル で,以下のように表せる.

 $|U| = [a]|u| \qquad (2)$

ここで, [a] は操作電圧から曲げモーメントへの変換定数 行列, [u] は操作電圧のベクトルである.式(1) にモード ベクトル[q] ($[X] = [\phi] [q]$) を導入し,さらに減衰を考慮 することで,制御対象は最終的に式(3) で示す各振動モ ードに非連成化されたl 個の独立な伝達関数により表現さ れる.

$$|y_{m}|_{(i)} = \frac{s^{2}}{s^{2} + 2\xi_{i}\omega_{i}s + \omega_{i}^{2}}|f_{m}|_{(i)} + \frac{s^{2}}{s^{2} + 2\xi_{i}\omega_{i}s + \omega_{i}^{2}}|u_{m}|_{(i)}$$
$$i = 1 \sim l \cdots \cdots \cdots (3)$$

99

516 56巻6号 (2004)

 研究速報
 報

 表1
 同定された固有周波数と減衰比

Mode	Natural frequency [Hz]		Damping ratio [%]
	Experiment	Calculation	Calculation
4th	3.82	3.67	5.0
5th	5.42	5.29	3.0
6th	6.02	6.01	2.0
8th	7.47	7.07	0.1
10th	10.9	11.1	2.5
15th	18.3	18.4	0.3

ここで、sはラプラス演算子、添字(i) はベクトルのi番 めの成分を示し、これはi次モード成分に対応する.ま た、 ω_i 、 ζ_i はそれぞれi次モードの固有円振動数、減衰比、 $\{f_m\}, \{u_m\}, \{y_m\}$ はそれぞれモード内生微振動外乱ベクト ル、モード操作量ベクトル、モード絶対加速度ベクトルで ある.

2.4 モデル同定実験

実験は、内生微振動外乱を模擬するように建物モデル1 階に加振器を設置して 0.1 ~ 50 Hz の狭帯域ランダム波で 加振したときの、加振力から各階の応答加速度までの伝達 特性と、各操作量から各フロアの加速度までの伝達特性を 測定し、解析と比較することでモデル同定した.表1に同 定された制御対象モードの固有振動数と減衰比を示す.

3.制御則

制御器はモデルマッチング法を用いて,各モードごとに 設計する.式(3)について,図5に示すような制御シス テムを考える.ここでr,u,y,v,dはそれぞれ目標値, 制御入力,制御量,観測ノイズ,内生微振動外乱を表わす ものとする.このシステムにおいて $y = y_m$, $d = f_m$, $u = u_m$ と おくと,yは次式で表わされる.

ここで、 P_{dy} および P_{uy} はプラントへの内生微振動外乱および制御入力から制御量までの開ループ伝達関数である.また、 $u = C_{ru}r + C_{yu}(y + v)$ より

$$y = (1 - P_{dy}C_{yu}) - 1(P_{uy}C_{ru}r + P_{uy}C_{yu}v + P_{dy}e) \dots \dots \dots \dots (5)$$

となる.ここで, C_{ru} , C_{yu} はそれぞれ,制御器の目標値および制御量から制御入力までの開ループ伝達関数である. これらから次の三つの伝達関数 W_{rv} , W_{vv} , W_{dv} が得られる.



これらはそれぞれ,目標値,ノイズ,外乱から制御量までの閉ループ伝達関数である.モデルマッチング法によりプロパな制御系が設計されるためには上記の伝達関数が以下の三つの条件を満たす必要がある.

(1) W_w, W_wの相対次数は P_wの相対次数以上である.

W_n, W_wの零点は P_wの零点を全て含む.

(3) (1+W_w) の零点は P_wの全ての極を含む.

なお,モデルマッチング法に関する詳細は文献(5)を参 考にされたい.制御器は,可能な限り各モードに減衰を付 加できるように,外乱*d*から制御量*y*までの伝達関数を指 定することによって設計した.また,制御対象外モードに よって起こるスピルオーバ不安定の回避のために,前置補 償器⁶⁾を用いた.

4.制御実験

制御実験では、建物モデル1階の中央に設置した加振器 により、0.1~50 Hzの狭帯域ランダム波で三次元に加振 することで設備機器による内生微振動を模擬した. 図6は 加振器の加振力から各階の応答加速度までの伝達特性を示 したもので、細線が非制御、太線が制御である.x方向に ついては、制御対象とした5次および10次モードのピー クが各階で低減されている.これはモード減衰比を5次は 13%に、また10次は10%に増加させているものである。 v方向についても同様に、制御対象とした4次および6次 モードのピークが各階で低減されており、モード減衰比を 4次は12%に、また6次は8%に増加させているものであ る. z方向については、制御対象とした8次および15次モ ードのピークが2階で低減されている.これはモード減衰 比を8次は15%に、また15次は10%に増加させている ものである.また、これらの制御によって、対象としたモ ード以外の周波数においてゲインを増大させるようなこと はなく,前置補償器の効果が表れている.



5. あとがき

総質量 6.9 t の免震半導体工場建物モデルを設計・製作 し、柱・はりにピエゾアクチュエータを組込んだスマート 構造によって内生微振動外乱に対するアクティブ制御を行 なった結果,良好な制御性能が得られることを実験によっ て確認した.また,前置補償器を用いることにより、スピ ルオーバ不安定を回避した.

今後は、さらに免震層に装備されたアクチュエータを用 いて、内生微振動および外来微振動に対するアクティブ制 御について検討する.

(2004年9月29日受理)

参考文献

- 梶原・ほか3名,日本機械学会論文集 (C編),63巻615 号,3735~3742,1997.
- 2) 藤田・ほか7名,日本機械学会論文集(C編),66巻647
 号,2122~2127,2000.
- 藤田・ほか5名,日本機械学会論文集(C編),61巻584 号,1337~1342,1995.
- 4) 嶋崎·藤田, 生産研究, 48巻9号, 449~452, 1996.
- 5) 田川・ほか3名,日本機械学会論文集(C編),54巻507 号,2689~2696,1988.
- 6) 梶原・藤田,日本機械学会論文集(C編),63巻,613号, 3003~3010,1997.